

1090202 有關第 97150911N01 號「基板處理裝置」發明專利舉發事件（106 年度行專訴字第 58 號）（判決日：108.6.27）

爭議標的：進步性

系爭專利：「基板處理裝置」發明專利

相關法條：專利法（102.1.1 施行）第 22 條第 2 項

【判決摘要】

原證 4 至 7 的組合能輕易完成系爭專利之「控制部，針對每個基板處理裂而改變處理基板的步驟」、「上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變基板處理步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。

原證 4 至 7 與系爭專利均為基板處理裝置之相同技術領域；原證 4 至 7 與系爭專利均為解決基板處理裝置維修或條件變更、試運轉時之問題，具有所欲解決問題之共通性；原證 4 至 7 與系爭專利均係基板處理裝置對基板進行成膜、曝光、顯像之步驟，具有功能或作用上的共通性；原證 4 至 7 具有結合動機。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（被舉發人）斯克林半導體科技有限公司前於 97 年 12 月 26 日以「基板處理裝置」向智慧財產局申請發明專利，經智慧財產局編為第 097150911 號審查，准予專利，並發給發明第 I394223 號專利證書。嗣原告（舉發人）吳美嬋先生於 102 年 10 月 4 日以系爭專利違反核准時專利法第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發。參加人則多次提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經智慧局審查，核認系爭專利 104 年 10 月 8 日更正本符合規定，依該更正本審查，於 105 年 10 月 14 日審定「請求項 2 至 11、13 至 14、16 至 20 舉發不成立」。原告不服，提起訴願，經濟部嗣以 106 年 06 月 23 日經訴字第 10606306100 號訴願決定書作成訴願駁回之決定。原告仍未甘服，提起行政訴訟，參加人於本件行政訴訟中申請更正系爭專利，經被告准予更正並公告在案。智慧財產法院以第 106 行專訴 58 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧財產局就系爭專利，應為「請求項 2 至 11、13 至 14、16 至 20 舉發成立，撤銷專利權」之處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點:原證 4 至 7 之組合是否足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性?

(二)系爭專利請求項 2 內容:一種基板處理裝置,用以處理基板,其包含以下元件:複數個基板處理列,可以大致水平方向搬送基板並同時對基板進行複數種類之處理;及控制部,針對每個基板處理列而改變處理基板的步驟;於上下方向排列設置上述複數個基板處理列;上述基板處理列分別具備有複數個處理單元、及將基板搬送至此等處理單元的主搬送機構;上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板,並同時在其他基板處理列藉由改變基板處理步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板,其中,上述複數個處理單元的種類,在基板處理列之間為相同。(附圖 1)

(三)舉發證據:原證 4 為 2004 年 3 月 18 日公開之日本第 2004-87675 號「基板處理裝置」專利案(附圖 2);原證 5 為 2004 年 8 月 26 日公開之日本第 2004-241319 號「成膜裝置」專利案(附圖 3);原證 6 為 1994 年 1 月 14 日公開之日本第 6-5689 號「半導體基板處理系統」專利案(附圖 4);原證 7 為 2005 年 4 月 14 日公開之日本第 2005-101078 號「基板處理裝置」專利案。

(四)智慧局見解:

- 1.原證 4 未記載控制部及其限制的動作條件,亦未提及試運轉。原證 5 記載之單一製程之成膜裝置,複數個處理室 12a、12b 進行蒸鍍處理其實係單一種製程步驟,且無法改變處理步驟。原證 6 的半導體基板處理系統 10 僅包含單一產線,非如同系爭專利的複數條處理列。原證 7 雖揭露生產前試運轉,仍僅為單一產線。
- 2.原證 4 至 7 均未揭示系爭專利請求項 2 之「控制部,針對每個基板處理列而改變處理基板的步驟」以及「上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板,並同時在其他基板處理列藉由改變基板處理步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」等技術特徵。

(五)法院判決見解:

- 1.原證 4 至 7 與系爭專利均為基板處理裝置之相同技術領域;原證 4 至 7 與系爭專利均為解決基板處理裝置維修或條件變更、試運轉時之問題,具有所欲解決問題之共通性;原證 4 至 7 與系爭專利均係基板處理裝置對基板進行成膜、曝光、顯像之步驟,具有功能或作用上的共通性;原證 4 至 7 具有結合動機。
- 2.«試運轉»用語解釋:係解釋為「以試驗、檢查、驗證或確認處理單元

對基板處理的品質或處理單元運作是否正常為目的之運轉」。

參加人主張應解釋為「以『通常運轉』以外的『其他基板處理列』，『改變處理基板的步驟』，以試驗、檢查、驗證或確認處理單元對基板處理的品質為目的之運轉」云云。惟查前述參加人主張之內容，係為系爭專利說明書及申請專利範圍用以說明系爭專利之「基板處理裝置」之整體技術內容、發明目的及界定其專利權範圍，而非用以解釋系爭專利之「試運轉」用語之文字意義，系爭專利之「試運轉」一詞，於系爭專利說明書及各請求項中，應為一致之解釋，並不會因為各請求項所界定之技術特徵不同，而有不同之解釋，參加人之主張尚不可採。

- 3.原證 4 至 7 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性:原證 4 第 0134 段揭露「一邊之處理列 13 對基板 W 進行第 1 處理，以其他處理列 13 對基板 W 進行與第 1 處理不同之第 2 處理」。原證 4 第 0134 段實質揭露一「控制部」以控制複數個處理列 13 以同時進行第 1 處理及第 2 處理，惟原證 4 並未揭露進行該第 1 處理、第 2 處理之目的，亦未提及任何試運轉之技術內容。原證 5 第 0046 段揭露在不同處理室併行進行的通常的成膜工序（相當於系爭專利之「通常運轉」）及條件試出（相當於系爭專利之「試運轉」），然而原證 5 之單一製程之成膜裝置在硬體結構上有別於系爭專利。原證 6 第 0034 段及圖 4 揭露「操作部 20 輸入進行處理之導體晶圓之片數、所使用處理裝置之種類及順序，再者藉由輸入關於各處理裝置之各處理條件，便可以一次的輸入作業來進行關於複數次處理工序的設定輸入，再者，可連續地進行該等處理工序」，由前述原證 6 之內容可知，操作部 20 可輸入設定所使用處理裝置之種類及順序，使控制裝置 19 可改變基板處理列之處理基板的步驟，原證 7 第 0002 段揭露「在對基板進行既定處理之基板處理裝置中，會在實際運作前進行用以確認其動作之試驗性運轉（動作測試）」。

綜上，原證 4 未揭露該控制部可以針對 2 個處理列 13 改變處理基板的步驟，未揭露系爭專利之「控制部，針對每個基板處理列而改變處理基板的步驟」、「在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。並依據前述原證 6 第 0013、0024、0034 段揭露相當於系爭專利之「試運轉」、「控制部，對基板處理列而改變處理基板的步驟」之內容，原證 5 第 0046 段揭露在不同處理室併行通常運轉及試運轉，簡單修飾原證 4 第 0134 段所實質揭露之「控制部」控制各處理列以進行之第 1 處理及第 2

處理，使原證 4 之第 1 處理及第 2 處理，其中之一者進行「通常運轉」而另一者可改變處理步驟以進行「試運轉」，即能輕易完成系爭專利之「控制部，針對每個基板處理列而改變處理基板的步驟」、「在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。

(六)分析：

- 1.智慧局認為原證 4 至 7 難以結合，而法院認為原證 4 至 7 具有結合動機。
 - (1)智慧局認為原證 5 所記載的控制裝置係要選擇將基板分送至 12a、12b 任一目的地做指示，非對改變處理基板的步驟做指示，難以與證據 2 之基板處理列控制作組合，且原證 6 的半導體基板處理系統 10 僅包含單一產線，並不可能達成所欠缺技術特徵 5 的內容。原證 4 至 7 所要控制的動作並不相同，應無結合之動機。
 - (2)法院認為原證 4 至 7 與系爭專利均為基板處理裝置之相同技術領域；原證 4 至 7 與系爭專利均為解決基板處理裝置維修或條件變更、試運轉時之問題，具有所欲解決問題之共通性；原證 4 至 7 與系爭專利均係基板處理裝置對基板進行成膜、曝光、顯像之步驟，具有功能或作用上的共通性；原證 4 至 7 具有結合動機。
- 2.就「原證 4 至 7 之組合是否足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性」

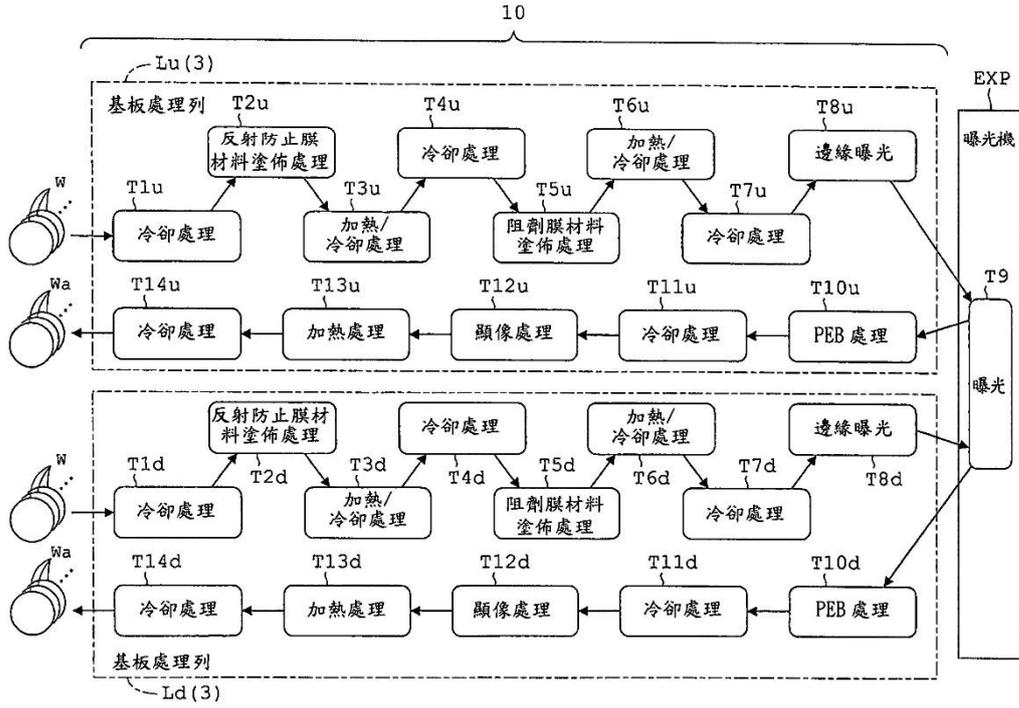
本局認為原舉發證據均未揭示系爭專利請求項 2 更正後所具有之「上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變基板處理步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。又縱使各證據皆為基板處理領域，然各證據用以達成控制的目的並不相同，因此以尚難證明系爭專利請求項 2 不具進步性；但法院先就更正後之「試運轉」用語應解釋為「以試驗、檢查、驗證或確認處理單元對基板處理的品質或處理單元運作是否正常為目的之運轉」…107 年 9 月 13 日之更正內容僅係就「控制部」為進一步之界定，而不會影響或改變前述系爭專利「試運轉」解釋；其次認為試運轉已被原證 5、6 揭露，可使原證 4 之第 1 處理及第 2 處理，其中之一者進行「通常運轉」而另一者可改變處理步驟以進行「試運轉」，即能輕易完成系爭專利請求項 2 之技術特徵 2、5，也造成本件進步性之認定結果產生差異。

三、總結

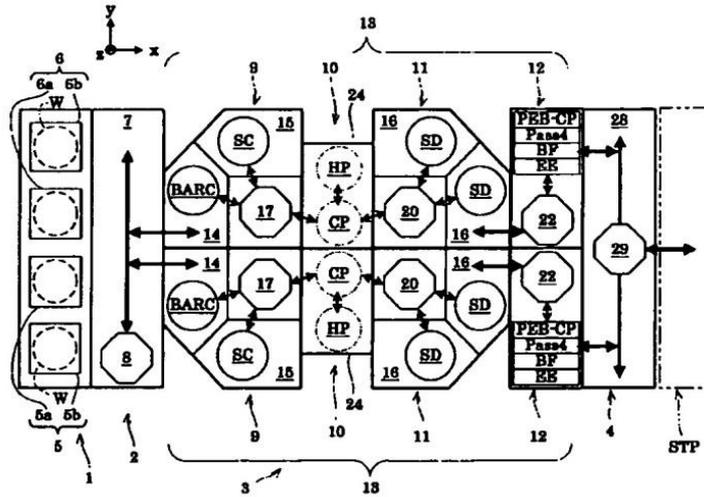
結合動機應就複數證據之間比對

2017年7月1日修訂施行之進步性審查基準，釐清判斷複數引證之結合動機，係應就「複數引證之間」技術內容的關聯性或共通性，而非考量「引證與發明」之間技術內容的關聯性或共通性，以避免後見之明，原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。法院在本案的進步性的組合動機論述，係將證據與系爭專利放在一起比對欲解決問題之共通性，及功能或作用上的共通性，有後見之明之虞，其組合動機之論述方式不符合新進步性審查基準。

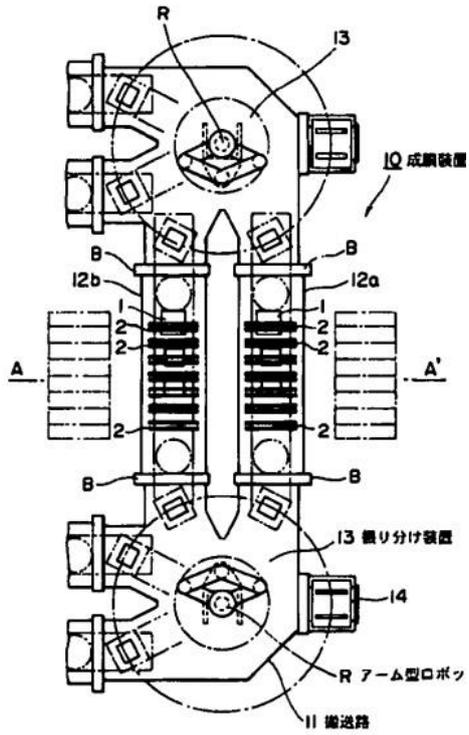
圖 1



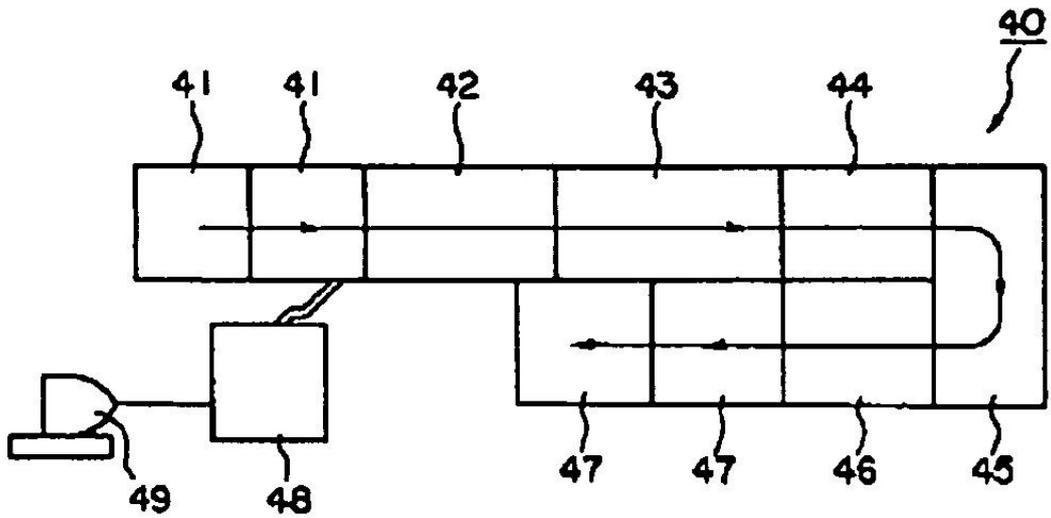
附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 2 主要圖式



附圖 3 證據 3 主要圖式



附圖 4 證據 4 主要圖式